

## ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА КРИТИЧЕСКИЙ ТОК ПЛЕНОК $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$

С.В.Антоненко, А.И.Головашкин, В.Ф.Елесин, И.А.Есин,  
В.Е.Жучков, С.И.Красносвободцев, Е.В.Печень, И.А.Руднев,

Сверхпроводящие пленки  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ , полученные методом лазерного напыления были облучены ионами  $\text{He}^{++}$  с энергией  $E = 3,6$  МэВ. Установлено: деградация  $J_c$  пленок при облучении происходит быстрее, чем  $T_c$ ; рост  $\Delta T_c$  и  $\rho$  опережает падение  $T_c$ ; критический ток пленок  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  более чувствителен к облучению, чем пленок  $\text{Nb}_3\text{Sn}$ .

Важным методом, позволяющим понять природу высоких критических параметров сверхпроводников, является изучение влияния на них радиационных дефектов. В работах <sup>1, 2</sup> было исследовано воздействие ионного облучения на критическую температуру пленок  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  и как оказалось, они на порядок более чувствительны к облучению, чем пленки  $\text{Nb}_3\text{Sn}$ . В данной работе изучается влияние ионного облучения на критический ток пленок  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ , а также на характер зависимости  $J_c$  от  $B$  и  $T$ .

Изготовление пленок соединения  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  проводилось методом импульсного лазерного распыления из мишеней сверхпроводящей керамики стехиометрического состава. Кристаллическая структура типа  $ABO_3$  формировалась непосредственно в процессе осаждения без последующей термообработки <sup>3</sup>. В качестве подложек использовались сапфир и  $\text{SrTiO}_3$ , плоскость последнего ориентировалась перпендикулярно оси [100] подложки. Наблюдался эпитаксиальный рост пленок с жесткой ориентацией кристаллографической оси [001] перпендикулярно поверхности образца.

Критическая температура  $T_c$  образцов определялась резистивно по середине перехода из нормального состояния в сверхпроводящее, а ширина перехода  $T_c$  определялась по уров-

нию  $0,9 \rho \div 0,1 \rho$ , где  $\rho$  – удельное сопротивление пленки вблизи перехода. Критический ток измерялся четырехконтактным методом по вольтамперным характеристикам на узкой полоске (мостике) пленки на установке, описанной в <sup>4</sup>. За критический принимался ток, при котором на потенциальных контактах образцов появлялось напряжение 2,5 мВ. Плотность критического тока  $J_c$  рассчитывалась делением полного критического тока на сечение мостика. При измерениях в магнитном поле выдерживалась геометрия, при которой вектор магнитной индукции  $B$  был параллелен поверхности образца и перпендикулярен току (см. ниже вставку на рис. 2). Основные характеристики пленок до облучения приведены в таблице.

№ образца	$T_{c\text{н}}$ , К	$T_c$ , К	$T_{c\text{к}}$ , К	$d$ , мкм	$J_{c\text{max}} (T=4,2 \text{ К}, B=0 \text{ Т})$	$J_c (T=77 \text{ К}, B=0 \text{ Т})$
1	89,0	84,7	76,4	1,0	$4 \cdot 10^2 \text{ А/см}^2$	–
2	90,0	89,4	88,9	0,26	$1,6 \cdot 10^6 \text{ А/см}^2$	$5 \cdot 10^5 \text{ А/см}^2$

Здесь  $T_{c\text{н}}$ ,  $T_{c\text{к}}$  – температуры, соответствующие значениям  $0,9 \rho$  и  $0,1 \rho$ , соответственно;  $d$  – толщина пленки;  $J_{c\text{max}}$  – максимальная зарегистрированная плотность критического тока для каждой из пленок.

Образцы облучались в вакууме ионами  $\text{He}^{+}$  с энергией  $E = 3,6 \text{ МэВ}$  флюенсами  $F = (2,5 \div 60) \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$ . Погрешность в определении флюенса  $\pm 5\%$ . Держатель образца охлаждался водой. Однородность облучения обеспечивалась механическим сканированием образца вдоль пучка ионов. В экспериментах после каждого флюенса измерялись зависимости  $J_c$  от магнитного поля и температуры,  $\rho$ ,  $T_c$ ,  $\Delta T_c$ .

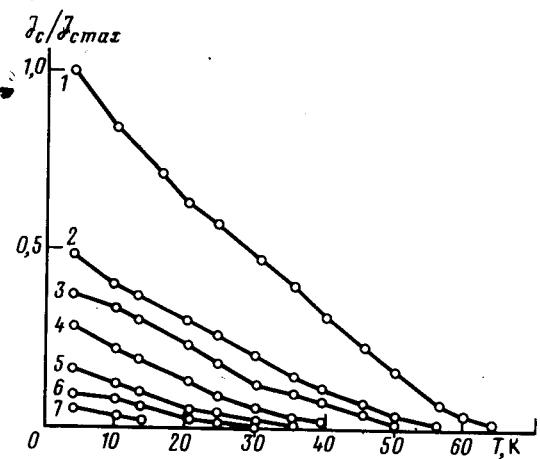


Рис. 1. Зависимость  $J_c/J_{c\text{max}}$  от температуры  $T$  при разных флюенсах.  $B = 0$ , образец 1: 1 –  $F = 0$ ; 2 –  $F = 1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ ; 3 –  $F = 2 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ ; 4 –  $F = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ ; 5 –  $F = 4 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ ; 6 –  $F = 5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ ; 7 –  $F = 6 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$

На рис. 1 и 2 приведены зависимости  $J_c/J_{c\text{max}}(T)$  и  $J_c/J_{c\text{max}}(B)$  при различных флюенсах. На рис. 3 представлены зависимости  $J_c/J_{c0}(F)$ ,  $T_c/T_{c0}(F)$ ,  $\Delta T_c/\Delta T_{c0}(F)$ ,  $\rho/\rho_0(F)$ , где  $J_{c0}$ ,  $T_{c0}$ ,  $\Delta T_{c0}$ , и  $\rho_0$  – соответственно плотность критического тока, критическая температура, ширина сверхпроводящего перехода и удельное электросопротивление при переходе из нормального в сверхпроводящее состояние до облучения. Кроме того, на этом же рисунке приведена зависимость  $J_c/J_{c0}(F)$  для пленок  $\text{Nb}_3\text{Sn}$ , облучавшихся аналогичным образом.

Анализ результатов приводит к следующим выводам:

- при облучении наблюдается сильное уменьшение критического тока, при этом отношение  $J_c/J_{c0}$  зависит от температуры и магнитного поля. При увеличении магнитного поля до  $0,5 T$  отношение  $J_c/J_{c0}$  падает, а затем до полей до  $3 T$  растет; при увеличении температуры  $J_c/J_{c0}$  уменьшается;

— при температуре кипения жидкого азота не замечено повышение плотности критического тока даже для малых флюенсов. Однако характер зависимостей  $J_c(B)$  при разных флюенсах указывает на то, что в области полей  $B > 3T$  возможно увеличение  $J_c/J_{c0}(B)$  при облучении;

- деградация  $J_c$  происходит значительно быстрее деградации  $T_c$ ; т. е. падение  $J_c$  при облучении определяется не только падением  $T_c$ ;
- рост  $\Delta T_c$  и  $\rho$  опережает падение  $T_c$ ;
- при флюенсе  $4 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$  наблюдается изменение характера зависимости  $\rho(T)$ , до перехода к сверхпроводимости, от металлического поведения к полупроводниковому;
- деградация  $J_c$   $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  пленок происходит значительно быстрее чем деградация  $J_c$  пленок  $\text{Nb}_3\text{Sn}$  (флюенс, соответствующий половинному падению  $J_c$  пленок  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  в  $8 \div 10$  раз меньше чем для  $\text{Nb}_3\text{Sn}$ );
- при увеличении флюенса не происходит резкого изменения формы зависимостей  $J_c(T)$  и  $J_c(B)$ ;
- при увеличении флюенса падение  $T_{cK}$  происходит значительно быстрее, чем падение  $T_{ch}$  и  $T_c$ .

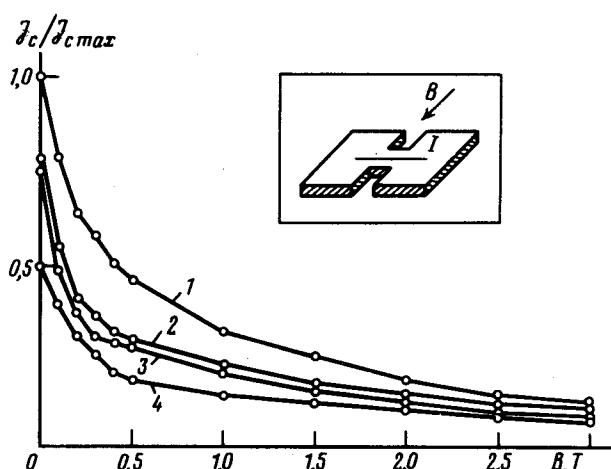


Рис. 2. Зависимость  $J_c/J_{cmax}$  от индукции магнитного поля  $B$  при различных флюенсах  $T = 77,6 \text{ K}$ ; образец 2: 1 —  $F = 0$ , 2 —  $F = 2,5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$ , 3 —  $F = 5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$ , 4 —  $F = 1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$

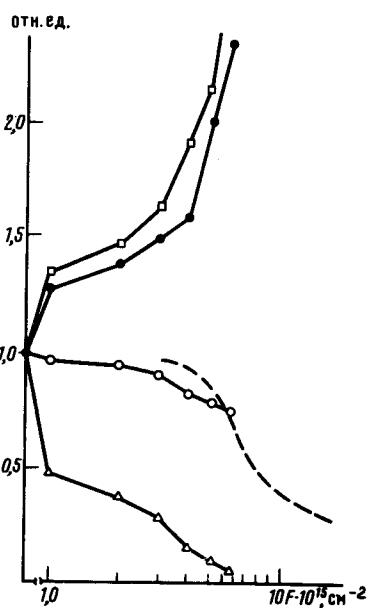


Рис. 3. Зависимости  $T_c/T_{c0}$ ,  $J_c/J_{c0}$ ,  $\Delta T_c/\Delta T_{c0}$ ,  $\rho/\rho_0$  от флюенса  $F$ , образец 1:  $\square - \rho/\rho_0(F)$ ;  $\bullet - \Delta T_c/\Delta T_{c0}(F)$ ;  $\circ - T_c/T_{c0}(F)$ ;  $\triangle - J_c/J_{c0}(F)$ ; при  $T = 4,2 \text{ K}$ ;  $B = 0 \text{ T}$ ;  $-- J_c/J_{c0}$  для пленок  $\text{Nb}_3\text{Sn}$

В качестве возможных причин деградации сверхпроводящих свойств можно указать на создание повреждений в подрешетках кислорода и меди в структуре  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ .

Авторы выражают благодарность Попову Б.М. и всему коллективу Циклотронной лаборатории МИФИ за помощь в работе.

### Литература

1. Антоненко С.В., Евстигнеев В.В., Елесин В.Ф. и др. Влияние ионного облучения на свойства оксидных высокотемпературных сверхпроводников. Труды рабочего совещания по проблемам высокотемпературной проводимости, Свердловск – Заречный, 7 – 10 июля 1987 г.
2. Антоненко С.В., Безотосный И.Ю., Григорьев А.И. и др. Письма в ЖЭТФ, 1987, 46, 362.
3. Головашкин А.И., Красносвободцев С.И., Печень Е.В., Родин В.В. Кр. сообщ. по физике ФИАН , 1987, № 9, с. 39.
4. Есин И.А., Руднев И.А. В сб.: Изменение свойств сверхпроводящих соединений типа A15 под воздействием излучений. М.: Энергоатомиздат, 1986, с. 49.

Московский  
инженерно-физический институт

Поступила в редакцию  
1 января 1988 г.